



<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 <b>台灣半導體研究中心</b>		DOCUMENT NO. :		TITLE :	
		Q3-NL04		設備作業標準 (CF-E14 8 吋全自動表面輪廓儀)	
ISSUE DATE		REVISION	1.0	PAGE	第 1 / 4 頁

#### 一、目的：

定義8吋全自動表面輪廓儀生產操作規範，以確保8吋全自動表面輪廓儀生產操作品質

#### 二、範圍：

適用於8吋全自動表面輪廓儀。

#### 三、權責：

1. 組織權責：製程人員負責制定及修改規範。
2. 設備負責人負責機台的異常處理，維持生產正常運轉。
3. 執行人員資格：經過 Tencor P-10 Surface Profiler 表面輪廓量測儀操作評鑑合格之蝕刻部門人員。

#### 四、名詞定義：

無。

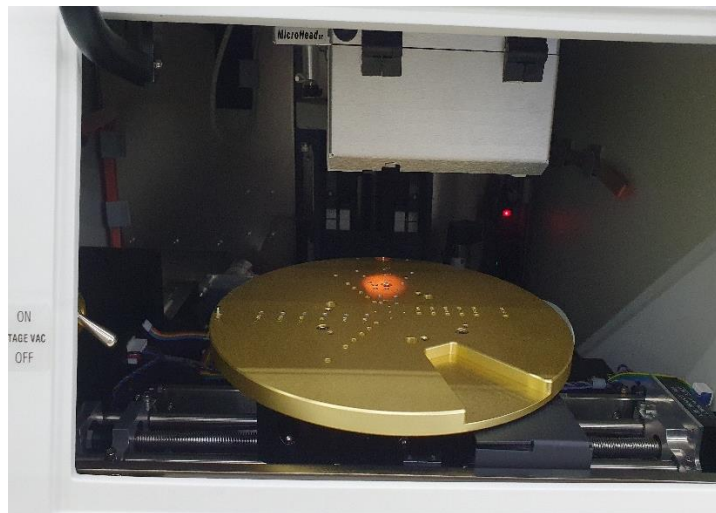
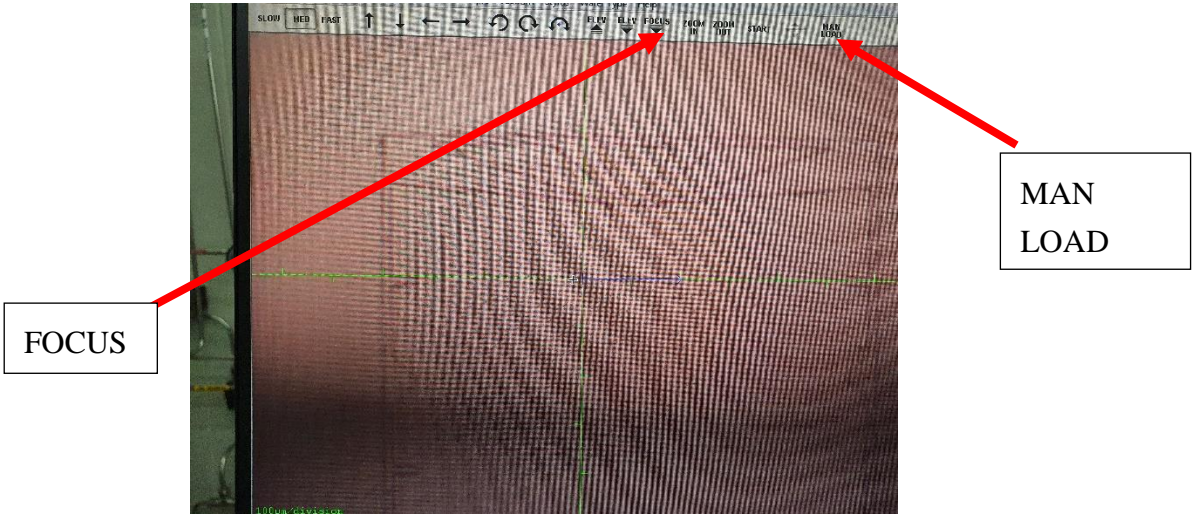
#### 五、相關文件：

8吋全自動表面輪廓儀 user m manual。

#### 六、標準作業程序：

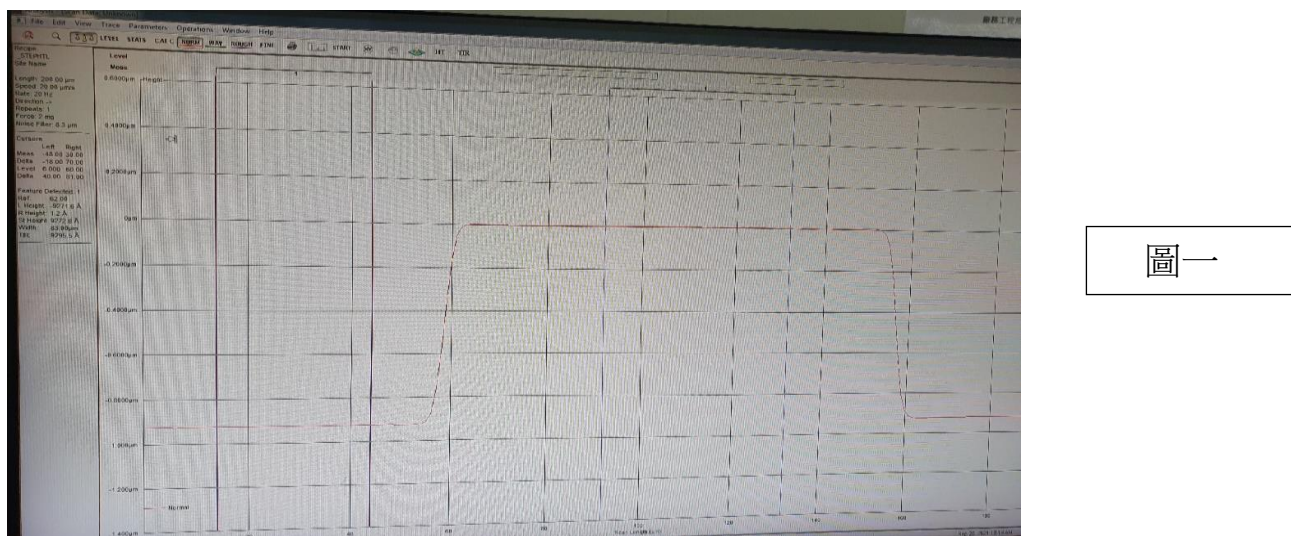
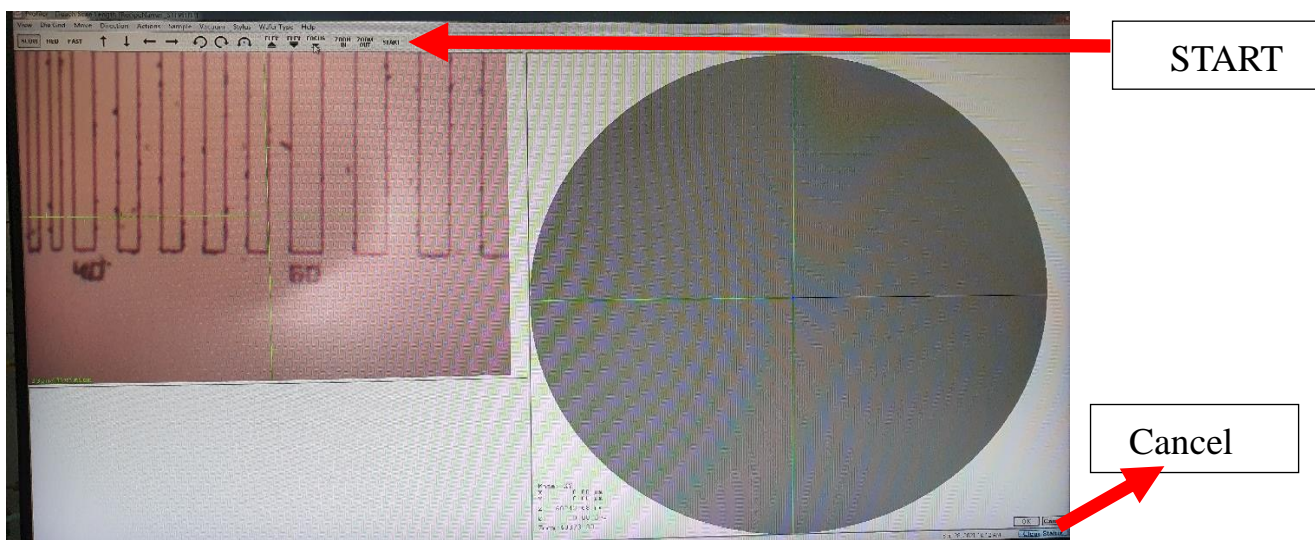
1. 檢查機台狀況，確定機台目前使用情形(綠牌:使用中、紅牌:維修中、黃牌:測試中)，線上刷卡開機 (web on)，填寫機台使用記錄表開始使用時間。







<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 <b>台灣半導體研究中心</b>		DOCUMENT NO. :	TITLE :		
		Q3-NL04	設備作業標準 (CF-E14 8吋全自動表面輪廓儀)		
ISSUE DATE		REVISION	1.0	PAGE	第 3 / 4 頁

2. 使用 MAN LOAD 將載台移出。
  3. 打開透明門，將晶片〔平邊朝外〕放置於載台上後開啟真空吸引開關。
  4. 關起透明門，使用 MAN LOAD將載台移入量測位置(操作過程中禁制開啟透明門)。
  5. 使用 FOCUS，讓探針到達樣品定置。
  6. 配合滑鼠鍵選擇欲掃描區域，或使用軌跡球控制 X-Y。
  7. 選定掃描區域後，按下”Cancel”鍵，進入 Recipe 選擇畫面，並選擇所需程式。
  8. 檢查或修改掃描程式參數，確定後按”START”開始掃描。
- 掃描完成後系統會自動跳至以下畫面(圖一)。





<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 <b>台灣半導體研究中心</b>		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-E14 8 吋全自動表面輪廓儀)		
ISSUE DATE		REVISION	1.0	PAGE	第 4 / 4 頁

9. 若掃描圖形為斜的，按 **level** 鍵叫出 L-L、R-R 以便將 scan 所得 profile 調至水平。
10.  雙鍵平移、 單鍵是改變寬度，將 L-L 和 R-R 調至同一高度平面，各張開一小段距離以取得平均值。
11. 再按一次 **level** 鍵，將圖修正成水平。
12. 將 L-L 和 R-R 各放在欲比較高度差(或寬度差)的區域，螢幕左邊即顯示高度差(或寬度差)。
13. 量測完成後，直接使用MAN LOAD將載台移出。
14. 打開透明門，關閉真空吸引後，將晶片取出。
15. 線上刷卡關機 (web off)，填寫機台使用記錄表結束時間。

## 七、應用表單及附件：

1. Q4-NL02 設備管理卡
2. Q4-NL03 設備考核表
3. Q4-NL04 設備點檢表
4. Q4-NL06 異常及矯正預防處理單